PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-242355

(43) Date of publication of application: 11.09.1998

(51)Int.CI.

H01L 23/40

H01L 23/12

H01L 23/28

(21)Application number: 09-040205

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

25.02.1997

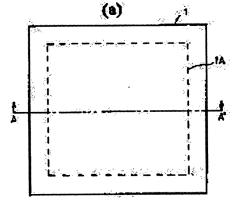
(72)Inventor: YOSHIKAWA YASUHIRO

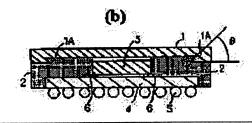
(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lessen the peel-off and crack developed at the junction interface of dissimilar low-thermal resistance materials different in thermal expansion coefficient and elastic modulus in a semiconductor integrated circuit device.

SOLUTION: The device has a heat sink 1 on the opposite surface of a package to a main surface having semiconductor element. The heat sink partly has a hook structure 1A for hooking a seal resin of the package. The device having a heat sink 1 on the surface of a package opposite to a main surface having semiconductor devices has at least an inverted circular or square conical through-hole at a part in the plane of the heat sink 1.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出類公開番号

特開平10-242355

(43) 公開日 平成10年(1998) 9月11日

(51) Int.Cl.*		識別紀号	FI		
HOIL	23/40		HOIL	23/40	E
	23/12			23/28	В
	23/28			23/12	L

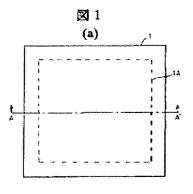
審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 6 頁)

(21)出職番号 特顯平9-40205 (71)出職人 000005108 株式会社日立製作所 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (72)発明者 吉川 泰弘 東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株 式会社日立製作所半導体事業部内

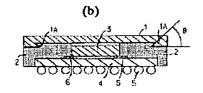
(54) 【発明の名称】 半導体集積回路装置 (57) 【要約】

【課題】 半導体集積回路装置において、低熱抵抗で、 熱膨張係数、弾性率の異なる異種材料間の接合界面に発 生する制離やクラックを低減する。

【解決手段】 半導体素子が形成されている主面と反対側のパッケージの表面上に放無板が設けられた半導体集績回路装置であって、前記放無板の一部が前記パッケージの對止機能を引掛けて係合するフック構造になっているものである。また、半導体素子が形成されている主面と反対側のパッケージの表面上に放無板が設けられた半導体集積回路装置であって、前記放無板平面内の少なくとも一部に逆円錐状もしくは逆角錐状の貫通孔を少なくとも「個設けたものである。



(74)代理人 弁理士 秋田 収喜



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体素子が形成されている主面と反対側のバッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集 様回路装置であって、前記放熱板の一部が前記パッケージの封止樹脂を引掛けて係合するフック構造となっいることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項 2】 半導体素子が形成されている主面と反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集 接回路装置であって、前記放熱板の周辺縁部の少なくと も一部が前記パッケージの封止機能を引掛けて係合する フック構造になっていることを特徴とする半導体集積回 路装置。

【請求項 4】 半導体素子が形成されている主面と反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集 様回路装置であって、前記放熱板の平面部に逆円継状も しくは逆角錐状の穴を少なくとも1個設けたことを特徴 とする半導体集積回路装置。

[請求項 5] 半導体素子が形成されている主面と反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集 様回路装置であって、前記放熱板の周辺縁部の少なくとも一部が前記パッケージの封止機能を引掛けて係合する フック構造になっており、前記放熱板の平面部に送円錐状もしくは送角錐状の貫通孔あるいは逆円錐状もしくは 送角錐状の穴を少なくとも1個設けたことを特徴とする 半導体集積回路装置。

【請求項 6】 前記放熱板の内面部に凹凸を少なくとも 1個設けたことを特徴とする請求項 1乃至5のうちいずれか1項 に記載の半導体集積回路装置。

【請求項 7】 前記放熱板の上面に放熱フィンを設けたことを特徴とする請求項 5 に記載の半導体集積回路装置。

【請求項 8】 前記パッケージはヒートスプレッダー付 ボール・グリッド・アレイ (BGA) 型であ ることを特 徴とする請求項 1乃至5のうちいずれか1項 に記載の半 導体集積回路装置。

【請求項 9】 前記セートスプレッダーの上面に放納フィンを設けたことを特徴とする請求項 8に記載の半導体 集積回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、半導体集積回路装置に関し、特に、ヒートスプレッダー付ボール・グリッド・アレイ(HBGA)型半導体集積回路装置に適用して有効な技術に関するものである。 【0002】

[0005]

【従来の技術】近年、半導体集積回路装置においては、 半導体素子の高集積化にとない入出力ピン数が急速に増 大している。外部端子をパッケージの周辺に設けるQF P (Quad Flat Package)等のパッケージは多ピンに なる程、はんだ接続時にピン間の絶縁を保ったの一定間 腐以下に外部端子を配置できないという制約からパッケージが大型化する傾向にある。このため実装効率が低下 したり、電気特性の劣化が生じやすいため、パッケージ 裏面に格子状に外部端子を設けるボール・グリッド・ア レイ(BGA)型パッケージが開発されている。

【ロロロ3】一方、ペレットの発熱量も増大の一途をた どっており、特に、高性能デバイスではパッケージの低 熱抵抗化が重要視されている。

【0004】 このような背景から モールド樹脂(レジン)の上面にヒートスプレッダーを設けたHBGA型のバッケージが開発されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、前記従来 の技術を検討した結果、以下の問題点を見いだした。

【0006】前記従来の技術では、熱膨張係数、弾性率の異なる異種材料間の接合においては、モールド後の熱収縮の起こる製造プロセス時やスイッチのオン・オフ

(ON・OFF)による温度サイクル時にモールド樹脂 (レジン)異面に剥離やクラックが発生するという問題 があった。

【0007】本発明の目的は、熱膨張係数、弾性率の異なる異種材料間の接合界面に発生する剥離やクラックを 低減することが可能な技術を提供することにある。

【0008】本発明の他の目的は、低熱抵抗で、かつ、 封止樹脂(モールドレジン)と放熱板の界面に発生する 剥離やクラックを低減することが可能なHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置を提供することにある。 【0009】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかになるである。

[0010]

[課題を解決するための手段] 本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば下 記のとおりである。

【0011】 (1) 半導体素子が形成されている主面と 反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導 体集積回路装置であって、前記放熱板の一部が前記パッ ケージの封止樹脂を引掛けて係合するフック構造になっ ているものである。

【0012】 (2) 半導体素子が形成されている主面と 反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導 体集積回路装置であって、前記放熱板の周辺縁部の少な くとも一部が前記パッケージの封止樹脂を引掛けて係合 するフック構造になっているものである。

【ロロ13】(3)半導体素子が形成されている主面と

反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集験回路装置であ、って、前記放熱板の平面部に逆円錐状もしくは逆角錐状の貫通孔を少なくとも 1 個設けたものである。

`. 🔊

【〇〇14】 (4) 半導体素子が形成されている主面と 反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導 体集検回路装置であって、前記放熱板の平面部に逆円鎌 状もしくは逆角錐状の穴を少なくとも1個設けたもので ある。

【0015】(5) 半導体素子が形成されている主面と 反対側のパッケージの表面上に放熱板が設けられた半導体集積回路装置であって、前記放熱板の周辺縁部の少なくとも一部が前記パッケージの封止樹脂を引掛けて係合するフック構造になっており、前記放熱板の平面部に逆円維状もしくは逆角維状の穴を少なくとも1個設けたものである。【0016】(5) 前記手段の各半導体集積回路装置において、前記放熱板の内面部に凹凸を少なくとも1個設けたものである。

【ロロ17】 (7) 前記手段の各半導体集積回路装置において、前記放熱板の上面に放熱フィンを設けたものである。

【0018】(8)前記パッケージはヒートスプレッター付ボール・グリッド・アレイ(BGA)型である。 【0019】(9)前記ヒートスプレッダーの上面に放熱フィンを設けたものである。

【0020】前記の手段によれば、放熱板の一部が前記パッケージの封止樹脂を引掛けて係合するフック構造となっているため、このフック構造のフック部に封止樹脂が嵌め込められ、かつ、放熱板と封止樹脂(モールドレジン)の接触面接が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、放熱板を非止樹脂の界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。すなわち、熱膨張係数、弾性率の異なる異種材料間の接合界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。

【0021】また、放熱板に逆円錐状もしくは逆角錐状の貫通孔を設けることにより、この貫通孔に封止樹脂が 嵌め込められ、かつ、放熱板と封止樹脂の接触面積が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、放熱板と封止樹脂の 界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。

【0022】また、放熱板の内面部に逆円継状もしくは 逆角錐状の穴を設けることにより、この穴にバッケージ の対止樹脂が嵌め込められ、かつ、放熱板と封止樹脂の 接触面積が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、放熱板 と封止樹脂の界面に発生する剥離やクラックを低減する ことができる。

【0023】また、放熱板の内面部に凹凸を設けたことにより、放熱板と封止樹脂との接触面積が大きくなるので、放熱効率を向上することができる。

【0024】また、前記セートスプレッダーの上面に放 熱フィンを設けたことにより、さらに、放熱効率を向上 することができる。

【0025】以下、本発明について、図面を参照して実施の形態とともに詳細に説明する。

【0025】なお、実施の形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

[0027]

【発明の実施の形態】

(実施形態 1)図 1 は本発明の実施形態 1 の H B G A型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図であ り、(a)は平面図、(b)は

(a) の A - A ² 線で切った断面図である。図 1 において、 1 はヒートスプレーダー(放熱板)、 1 Aはフック 構造、 2 はモールドレジン(封止樹脂)、 3 はLSiチップ、 4 は配線基板、5 はボール(外部電極)、 6 は配線基板 4 上に設けられた配線電極(パッド)である。

【0029】前記フック構造1Aを有するヒートスプレーダー1をモールドレジン2に嵌め込む手段は、例えば、モールドレジン2で封止する際に、あ らかじめフック構造1Aを有するヒートスプレーダー1を金型内に固定しておき、一体成形することにより製作する。

【0030】この時、モールドレジン2の熱膨張係数に 近い材質(例えば、銅)のヒートスプレーダー1を選定 することにより、熱膨張係数差により発生する応力を低 減することができる。

【0031】このように構成することにより、前記フック構造1Aのフック部にバッケージのモールドレジン2が飲め込められ、かつ、前記ピートスプレーダー1とパッケージのモールドレジン2との接触面積が大きくなる、ケージ、低熱抵抗で、かつ、モールドレジン2ととートスプレーダー1の界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。すなわち、低熱抵抗で、かつ、熱膨張

係数、弾性率の異なる異種材料間の接合界面に発生する 剥離やクラックを低減することができる。

【0032】(実施形態2)図2は本発明の実施形態2 のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略 構成を示す平面図及び断面図であ り、(a)は平面図、

(b) は(a) のA - A' 線で切った断面図である。図 2において、18はヒートスプレーダー1に設けられた 逆円錐状もしくは逆角錐状の貫通孔である。

【0033】本実施形態2のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置は、図2に示すように、LSiチップ3の半導体素子が形成されている主面と反対側のモールドレジン2の表面上にヒートスプレーダー1が設けられた半導体集積回路装置であって、前記ヒートスプレーダー1の平面内の少なくとも一部に逆円錐状もしくは逆角錐状の貫通孔1Bを少なくとも1個設けたものである。

【0034】すなわち、前記実施形態 1 におけるヒート スプレーダー 1 のフック構造 1 Aの代りに、逆円錐状も しくは逆角錐状の貫通孔 1 Bを設けたものであ る。

【0035】前記セートスプレーダー1に設けられた食 通孔1Bをモールドレジン2で埋め嵌め込む手段は、例 えば、モールドレジン2で封止する際に、あらかじめ食 通孔1Bをを設けたヒートスプレーダー1を金型内に固 定しておき、一体成形することにより製作する。

【〇〇36】 このように構成することにより、前記貫通孔1日にパッケージのモールドレジン2が嵌め込められ、かつ、前記ヒートスプレーダー1とパッケージのモールドレジン2との接触面接が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、モールドレジン2とヒートスプレーダー1の界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。

【0037】(実施形態3)図3は本発明の実施形態3 のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略 構成を示す平面図及び断面図であ り、(a)は平面図、

(b) は(a) のA-A 線で切った断面図である。 【0038】 本実施形態2のHBGA型のパッケージの半導体集機回路装置は、図3に示すように、LSIケップ3の半導体素子が形成されている主面と反対側のモールドレジン2の表面上にヒートスプレーダー1が設けられた半導体集機回路装置であって、前記ヒートスプレーダー1の周辺縁部の少なくとも一部が前記モールドレジン2を引掛けて係合するフック構造1Aになっており、前記ヒートスプレーダー1の平面内の少なくとも一部に逆円維状もしくは逆角錐状の貫通孔1Bを少なくとも1個設けたものである。

【0039】 このように構成することにより、前記フック構造 1 A のフック部にパッケージのモールドレジン2が嵌め込められ、かつ、前記貫通孔 1 B にパッケージのモールドレジン2 が嵌め込められ、さらに、前記セートスプレーダー 1 とパッケージのモールドレジン2 との接

触面検が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、モールドレジン2とヒートスプレーダー1の界面に剥離やクラックの発生をさらに低減することができる。

【0040】(実施形態4)図4は本発明の実施形態4のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A'線で切った断面図である。図4において、10はヒートスプレーダー1の内部平面に設けられた凹凸である。

【〇〇41】本実施形態 4のHBG A型のパッケージの半導体集積回路装置は、図4に示すように、LSiチップ3の半導体素子が形成されている主面と反対側のモールドレジン2の表面上にヒートスプレーダー1が設けられた半導体集積回路装置であって、前記ヒートスプレーダー1の周辺縁部の少なくと一部が記パッケージの対止樹脂を引掛けて係合するフック構造1 Aを有し、前記ピートスプレーダー1の内部平面に凹凸1 Cを少なくとも1 個設けたものである。前記凹凸1 Cはヒートスプレーダー1を貫通する構造にしてもよい。

【0042】このように構成することにより、前記フック構造1Aのフック部にバッケージのモールドレジン2が嵌め込められ、かつ、前記ピートスプレーダー1とパッケージのモールドレジン2と映触面積が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、モールドレジン2とピートスプレーダー1の界面に剥離やクラックの発生をさらに低減することができる。

【0043】(実施形態5)図5は本発明の実施形態5のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A'線で切った断面図である。図4において、10はヒートスプレーダー1の内部平面に設けられた逆円錐状もしくは逆角錐状の穴である。

【0044】本実施形態5のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置は、図5に示すように、LSiチップ3の半導体素子が形成されている主面と反対側のモールドレジン2(パッケージ)の表面上にヒートスプレーダー1が設けられた半導体集積回路装置であって、前記ビートスプレーダー1の内部平面内の少なくとも一部に送円錐状もしくは送角錐状の穴1Dを少なくとも1個設けたものである。

【0045】すなわち、前記実施形態 1 におけるヒート スプレーダー 1 のフック構造 1 Aの代りに、前記ヒート スプレーダー 1 の内部平面内に逆円錐状も しくは逆角錐 状の穴 1 Dを設けたものである。

【0046】前記セートスプレーダー1の内部平面内の少なくとも一部に逆円錐状もしくは逆角錐状の穴1Dをモールドレジン2で埋め込む手段は、例えば、モールドレジン2で封止する際に、あらかじめ逆円錐状もしくは逆角錐状の穴1Dを設けたセートスプレーダー1を金型に固定しておき、一体成形することにより製作する手法

を用いる。

【0047】 このように構成することにより、前記逆円 錐状もしくは逆角錐状の穴10にパッケージの封止樹脂 が嵌め込められ、かつ、前記ヒートスプレーダー1とパ ッケージの封止樹脂との接触面様が大きくなるので、低 熱抵抗で、かつ、モールドレジン2とヒートスプレーダ ー1の界面に剥離やクラックの発生を前記実施形態1よ りもさらに低減することができる。

【0048】(実施形態 6)図 6は本発明の実施形態 6 のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A'線で切った断面図である。図 6において、7はヒートスプレーダー1の上面に設けられた放熱フィンである。

10049】 前記実施形態6のHBG A型のパッケージの半導体集接回路装置のヒートスプレーダー1の上面に放熱フィンを設け、放熱効率を向上させたものである。 【0050】以上、本発明者によってなされた発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸眠しない範囲において種々変更し待ることは勿論であ

[0051]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0052】 (1) 放熱板の一部がパッケージの封止樹脂を引掛けて係合するフック構造になっていることとにより、前記フック構造のフック部に封止樹脂が嵌め込められ、かつ、前記飲熱板と封止樹脂の接触面核が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、放熱板と封止樹脂界面に発生する剥離やクラックの発生を低減することができる。すなわち、熱膨張係数、弾性率の異なる異種材料間の接合界面に発生する剥離やクラックを低減することができる。

【0053】(2)放熱板に送円錐状もしくは送角錐状 の貫通孔を設けることにより、この貫通孔に封止樹脂が 嵌め込められ、かつ、前記放熱板と封止樹脂の接触面積 が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、封止樹脂と放熱 板との界面に団生する剥離やクラックを低減することが できる。

【0054】(3) 放無板の内面部に凹凸を設けたことにより、放無板と對止樹脂の接触面接が大きくなるので、放無効率を向上することができる。

【0055】(4)飲熱板の内面部に逆円錐状もしくは 逆角錐状の穴を設けることにより、この穴に封止樹脂が 飲め込められ、かつ、前記飲熱板と封止樹脂の接触面積 が大きくなるので、低熱抵抗で、かつ、封止樹脂界面に 発生する刺離やクラックを低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

【図2】本発明の実施形態2のHBGA型のパッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

【図3】本発明の実施形態3のHBGA型のバッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

【図4】本発明の実施形態4のHBGA型のバッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

【図5】本発明の実施形態5のHBGA型のバッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

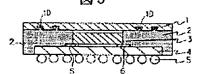
【図6】本発明の実施形態6のHBGA型のバッケージの半導体集積回路装置の概略構成を示す平面図及び断面図である。

【符号の説明】

1…ヒートスプレーダー(放無板)、1 A…フック構造、1 B…送円錐状もしくは送角錐状の貫通孔、1 C…凹凸、1 D…送円錐状もしくは送角錐状の穴、2…モールドレジン(對止樹脂)、3… LS i チップ、4…配線を板、5…ボール(外部電極)、6…配線電極(パッド)、7…放熱フィン。

(Ø 5)

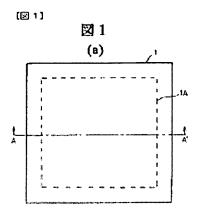
図 5

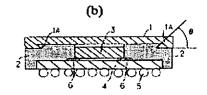


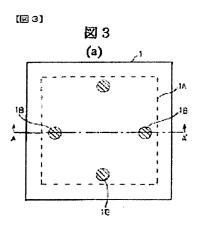
(Ø 6)

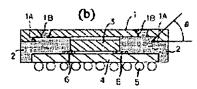
図6

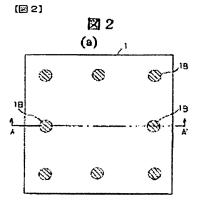
2-12-22-21-22-30-00-5

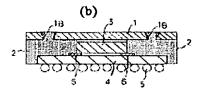


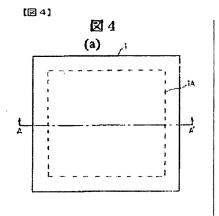


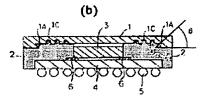












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.